

公開番号 又は 特許番号	WO2012-108316、再表 2012-108316
発明名称	微細孔を有する基体の製造方法、及び基体
出願人 又は 権利者	株式会社フジクラ、国立大学法人東京大学
想定デバイス	バイオ分析チップ、その他
要約	<p><b>【利用分野】</b> 微細孔を有する基体の製造方法、および微細孔を有する基体に関するもの。</p> <p><b>【発明の内容】</b> 孔径がナノオーダーの大きさで、且つ、微細な周期構造を備えた微細孔を有する基体の製造方法および前記基体の提供するものであり、基体の内部において、ピコ秒オーダー以下のパルス時間幅を有する第一のレーザー光の焦点を走査して、少なくとも1つの第一改質部および第二の改質部を形成し、前記基体の内部においてピコ秒オーダー以下のパルス時間幅を有する第二のレーザー光の焦点を走査して、複数の第三改質部及び第四改質部からなる、周期的な改質群を形成し、前記第一改質部および前記第二改質部と前記改質群とが重なるように、或いは、接するように形成された基体を得て、前記第一改質部および前記第三改質部エッチングによって除去して前記微細孔を形成することを特徴とする微細孔を有する基体の製造方法。</p>
図面	<p>【62248】</p>